



中华人民共和国国家标准

GB/T 4060—2007
代替 GB/T 4060—1983

硅多晶真空区熔基硼检验方法

Polycrystalline silicon—Examination method—
Vacuum zone-melting on boron

2007-09-11 发布

2008-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
硅多晶真空区熔基硼检验方法
GB/T 4060—2007

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字
2008年2月第一版 2008年2月第一次印刷

*

书号: 155066·1-30535 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准是对国家标准 GB/T 4060—1983《硅多晶真空区熔基硼检验方法》的修订。

本标准与 GB/T 4060—1983 相比,主要变动如下:

- 检测杂质浓度范围扩大为 $0.002 \times 10^{-9} \sim 100 \times 10^{-9}$;
- 增加了“规范性引用文件”、“术语”、“允许差”、“计算”;
- 将原标准中的第 5 章“检验条件”修订为“干扰因素”;
- 将原标准中的取样位置修订为距多晶硅棒表面不低于 5 mm,距多晶硅棒底部不低于 50 mm;
- 将原标准中的试样尺寸范围修订为直径 15 mm~20 mm,长度为 180 mm。

本标准自实施之日起,同时代替 GB/T 4060—1983。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准起草单位:峨眉半导体材料厂。

本标准主要起草人:罗莉萍、梁洪、覃锐兵、王炎、王向东。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 4060—1983。